

Antonia Stengele-Mast

Auszubildende Physiklaborantin (3./3,5. Lehrjahr)

✉ antonia.stengele@example.de

☎ +49 89 60 88 3142

📍 München, Deutschland



🌐 linkedin.com/in/antonia-stengele



PROFIL

Auszubildende Physiklaborantin im 3,5. Lehrjahr bei Infineon Technologies AG in Neubiberg/München mit IHK-Abschlussprüfung Sommer 2026. Berichtszeugnis 1,4 (Städtische Berufsschule fuer Mess- und Regeltechnik München) und Zwischenprüfung Teil 1 IHK München-Oberbayern 39/40 Punkte. Vier Stationen (Halbleiter-Messtechnik, Reinraum, Spektroskopie, Vakuumtechnik) mit Waferprober-Erfahrung und LabVIEW-Messdatenerfassung. Beste Auszubildende des Jahrgangs.

BERUFSERFAHRUNG

Auszubildende Physiklaborantin - Station Halbleiter-Messtechnik

09/2024 - heute

Infineon Technologies AG

Neubiberg, Deutschland

Duale Ausbildung mit 4 Stationen + Berufsschule fuer Mess- und Regeltechnik München

- Elektrische Wafer-Parametrik am Waferprober mit Keysight B1500A Semiconductor Analyzer, 60 Wafer/Woche, Messdaten-Erfassung via LabVIEW
- Reinraum-Handling ISO 14644 Klasse 5 (Schutzkleidung, Wafer-Transport, Partikelkontrolle) ueber 6 Monate ohne Kontaminationsvorfall
- Schichtdickenmessung mit Ellipsometer (Sentech SE 850) an 220 Oxidschichten, Abweichung zur Sollvorgabe unter 1,5 %
- Zwischenprüfung Teil 1 IHK München-Oberbayern 39/40 Punkte, Halbleiter-Messtechnik 98 %, beste Auszubildende des Jahrgangs (1 von 18)
- GLP-konforme Versuchsprotokolle fuer 14 Messreihen mit Messunsicherheit nach GUM, 0 Beanstandungen bei 6 internen Audits

AUSBILDUNG

Berufsausbildung 3,5 Jahre

09/2022 - 02/2026

Städtische Berufsschule fuer Mess- und Regeltechnik + Infineon Lehrwerkstatt

München, Deutschland

Physiklaborant:in (IHK)

1,4

Abitur

08/2014 - 06/2022

Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching

Garching bei München, Deutschland

Allgemeine Hochschulreife (Physik / Mathematik LK)

GPA: 1,9

FÄHIGKEITEN

- Waferprober Keysight B1500A
- Ellipsometer Sentech SE 850
- Reinraum-Handling ISO 14644
- Klasse 5
- LabVIEW Messdatenerfassung
- Oszilloskop / Spektrumanalysator
- R&S
- Messunsicherheit GUM
- Origin / Python Datenauswertung
- GLP-Dokumentation

PROJEKTE

IHK-Projektarbeit Wafer-Yield-Analyse

10/2024 - 03/2025

Abschluss-Projektarbeit zur statistischen Auswertung von Parametrik-Messdaten in Python, Identifikation einer Drift-Quelle, die den Wafer-Yield um 1,8 Prozentpunkte verbesserte

ZERTIFIKATE

IHK München-Oberbayern Zwischenprüfung Teil 1 Physiklaborant (39/40 Punkte)

03/2025

Reinraum-Qualifikation ISO 14644 Klasse 5 (Infineon Cleanroom Academy)

01/2025

Laserschutzbeauftragter DIN EN 60825 (TUEV Sued)

11/2024

Erste Hilfe + DGUV V3 (Infineon Werksicherheit)

09/2024

SPRACHEN

Deutsch
Englisch
Spanisch

Muttersprache
B2
A2

STÄRKEN

Reinraum-Disziplin

6 Monate Reinraum-Handling ISO 14644 Klasse 5 ohne Kontaminationsvorfall, sichere Gowning-Routine

Messpräzision

Ellipsometrie-Schichtdickenmessung mit Abweichung unter 1,5 % zur Sollvorgabe an 220 Oxidschichten

Leistungsstärke

Berichtszeugnis 1,4, Zwischenprüfung 39/40, beste Auszubildende des Jahrgangs (1 von 18)